

3次元測定機

UMC 850
(Carl zeiss)



ステージ上のワークにプローブを当て、縦・横・高さから3次元座標を取得し、寸法・位置度・輪郭形状等を高精度に測定が可能。

他の測定機では測定が困難な項目(仮想原点から特定の穴の3次元的な座標等)を高精度に測定が可能。

ワーク最大寸法: 850 x 1200 x 60mm

プローブ最小径、測定可能穴深さ: $\phi 1.4 \times L15\text{mm}$